

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

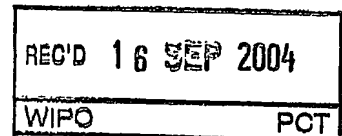
25.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 6 月 2 7 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 8 4 0 9 2
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 8 4 0 9 2]



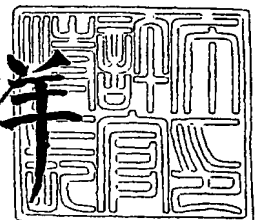
出 願 人
Applicant(s): 日本碍子株式会社
本田技研工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 9 月 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願

【整理番号】 WP04431

【提出日】 平成15年 6月27日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H05H 1/00
F01N 3/00

【発明の名称】 プラズマ発生電極及びプラズマ反応器

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 宮入 由紀夫

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 藤岡 靖昌

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 榊田 昌明

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 佐久間 健

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 波多野 達彦

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 佐藤 祥弘

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088616

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 一平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009689

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9001231

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラズマ発生電極及びプラズマ反応器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一对の単位電極が所定間隔を隔てて配設されてなり、これらの単位電極間に電圧を印加することによってプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極であって、

前記一对の単位電極のそれぞれが、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成されるとともに、それぞれの一の表面に、所定パターンで配設された所定厚さの複数の突条を有し、

前記一对の単位電極のうち一方の単位電極（上側単位電極）の、前記一の表面及びそこに配設された前記突条の表面と、他方の単位電極（下側単位電極）の裏面とによって、前記突条の配設方向の両端が開放された複数の空間を形成した状態で、前記一对の単位電極（上側単位電極及び下側単位電極）が、前記突条の厚さに相当する間隔を隔てて階層的に積層されて、一つの基本ユニットを構成し、さらに、

前記基本ユニットの複数の、階層的に積層されて、前記突条の厚さに相当する間隔を隔てるとともに、前記単位電極及び前記空間が立体的に配列された電極ユニットを構成し、

前記電極ユニットを構成する前記単位電極間に電圧を印加することによって、立体的に配列された前記空間内にプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極。

【請求項2】 前記単位電極及び前記突条の配設方向の両端が開放された前記複数の空間が、前記単位電極の外形に切断代を加えた形状の原単位電極の一の表面側に、その外形が前記原単位電極とほぼ同一であるとともに厚さが前記突条と同一で、かつその長辺が前記突条の長さと同じ又は長く、その短辺が前記突条の配設間隔と同一の形状の複数の貫通孔が形成された板状の突条形成用枠体を配設した状態で、前記原単位電極及び前記突条形成用枠体を、前記空間の前記両端となる位置で、前記原単位電極の一の表面に対しほぼ垂直な平面で切断することによって形成されてなる請求項1に記載のプラズマ発生電極。

【請求項 3】 前記基本ユニットが、その上面の前記突条の配設領域以外の領域から前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜のいずれかの少なくとも一部にそれぞれ接触した状態で上下方向に貫通する第一の導通用貫通孔及び第二の導通用貫通孔を有してなり、

前記第一の導通用貫通孔及び前記第二の導通用貫通孔、並びに前記導電膜のそれぞれを経由して、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電気的な導通が可能である請求項 1 又は 2 に記載のプラズマ発生電極。

【請求項 4】 前記基本ユニットが、前記第一の導通用貫通孔及び前記第二の導通用貫通孔のそれぞれの内壁に配設された導電膜（第一の貫通孔導電膜及び第二の貫通孔導電膜）を有してなり、前記第一の貫通孔導電膜及び前記第二の貫通孔導電膜と、前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜とがそれぞれ接触することによって、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電気的な導通を可能としている請求項 3 に記載のプラズマ発生電極。

【請求項 5】 前記基本ユニットを構成する前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜が、前記基本ユニットの、前記突条の配設方向と垂直な方向の両端部までそれぞれ延設されるとともに、

前記基本ユニットが、前記両端部のそれぞれの側の端面に配設された導電膜（第一の端面導電膜及び第二の端面導電膜）を有してなり、前記第一の端面導電膜及び前記第二の端面導電膜と、前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜とがそれぞれ接触することによって、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電気的な導通を可能としている請求項 1 又は 2 に記載のプラズマ発生電極。

【請求項 6】 請求項 1～5 のいずれかに記載のプラズマ発生電極を備えてなり、前記プラズマ発生電極（電極ユニット）を構成する複数の前記単位電極間に立体的に配列された前記空間内に所定の成分を含有するガスが導入されたときに、前記空間内に発生させたプラズマにより前記ガス中の前記所定の成分を反応させることが可能なプラズマ反応器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、プラズマ発生電極及びプラズマ反応器に関する。さらに詳しくは、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能であるとともに、耐熱性に優れたプラズマ発生電極及びプラズマ反応器に関する。

【0002】

【従来の技術】 二枚の電極間に誘電体を配置し高電圧の交流、あるいは周期パルス電圧をかけることにより、無声放電が発生し、これによりできるプラズマ場では活性種、ラジカル、イオンが生成され、気体の反応、分解を促進することが知られており、これをエンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガスに含まれる有害成分の除去に利用できることが知られている。

【0003】 例えば、エンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガスを、プラズマ場内を通過させることによって、このエンジン排気ガスや各種の焼却炉排気ガス中に含まれる、例えば、NO_x、カーボン微粒子、HC、CO等进行处理する、プラズマ反応器等が開示されている（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

【特許文献1】

特開 2001-164925号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、プラズマをできるかぎり低電力で安定的に均一に発生させる構造を採ろうとすると、電極間距離を小さくする必要があり、部品点数が多くなるとともに組み付けが煩雑となり生産性が低いという問題があった。また、プラズマ発生電極に熱応力が加わったときには、熱応力によりプラズマ発生電極が破損することがあるという問題もあった。

【0006】 本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能であるとともに、耐熱性に優れたプラズマ発生電極及びプラズマ反応器を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上述の目的を達成するため、本発明は、以下のプラズマ発生電極及びプラズマ反応器を提供するものである。

【0008】

[1] 少なくとも一对の単位電極が所定間隔を隔てて配設されてなり、これらの単位電極間に電圧を印加することによってプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極であって、前記一对の単位電極のそれぞれが、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成されるとともに、それぞれの一の表面に、所定パターンで配設された所定厚さの複数の突条を有し、前記一对の単位電極のうち一方の単位電極（上側単位電極）の、前記一の表面及びそこに配設された前記突条の表面と、他方の単位電極（下側単位電極）の裏面とによって、前記突条の配設方向の両端が開放された複数の空間を形成した状態で、前記一对の単位電極（上側単位電極及び下側単位電極）が、前記突条の厚さに相当する間隔を隔てて階層的に積層されて、一つの基本ユニットを構成し、さらに前記基本ユニットの複数の、階層的に積層されて、前記突条の厚さに相当する間隔を隔てるとともに、前記単位電極及び前記空間が立体的に配列された電極ユニットを構成し、前記電極ユニットを構成する前記単位電極間に電圧を印加することによって、立体的に配列された前記空間内にプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極。

【0009】

[2] 前記単位電極及び前記突条の配設方向の両端が開放された前記複数の空間が、前記単位電極の外形に切断代を加えた形状の原単位電極の一の表面側に、その外形が前記原単位電極とほぼ同一であるとともに厚さが前記突条と同一で、かつその長辺が前記突条の長さと同じ又は長く、その短辺が前記突条の配設空間と同一の形状の複数の貫通孔が形成された板状の突条形成用枠体を配設した状態で、前記原単位電極及び前記突条形成用枠体を、前記空間の前記両端となる位置で、前記原単位電極の一の表面に対しほぼ垂直な平面で切断することによって形成されてなる [1] に記載のプラズマ発生電極。

【0010】

[3] 前記基本ユニットが、その上面の前記突条の配設領域以外の領域から前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜のいずれかの少なくとも一部にそれぞれ接触した状態で上下方向に貫通する第一の導通用貫通孔及び第二の導通用貫通孔を有してなり、前記第一の導通用貫通孔及び前記第二の導

通用貫通孔、並びに前記導電膜のそれぞれを経由して、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電氣的な導通が可能である [1] 又は [2] に記載のプラズマ発生電極。

【0011】

[4] 前記基本ユニットが、前記第一の導通用貫通孔及び前記第二の導通用貫通孔のそれぞれの内壁に配設された導電膜（第一の貫通孔導電膜及び第二の貫通孔導電膜）を有してなり、前記第一の貫通孔導電膜及び前記第二の貫通孔導電膜と、前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜とがそれぞれ接触することによって、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電氣的な導通を可能としている [3] に記載のプラズマ発生電極。

【0012】

[5] 前記基本ユニットを構成する前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜が、前記基本ユニットの、前記突条の配設方向と垂直な方向の両端部までそれぞれ延設されるとともに、前記基本ユニットが、前記両端部のそれぞれの側の端面に配設された導電膜（第一の端面導電膜及び第二の端面導電膜）を有してなり、前記第一の端面導電膜及び前記第二の端面導電膜と、前記上側単位電極及び前記下側単位電極に配設された前記導電膜とがそれぞれ接触することによって、前記基本ユニットの前記上面から下面までの電氣的な導通を可能としている [1] 又は [2] に記載のプラズマ発生電極。

【0013】

[6] [1] ~ [5] のいずれかに記載のプラズマ発生電極を備えてなり、前記プラズマ発生電極（電極ユニット）を構成する複数の前記単位電極間に立体的に配列された前記空間内に所定の成分を含有するガスが導入されたときに、前記空間内に発生させたプラズマにより前記ガス中の前記所定の成分を反応させることが可能なプラズマ反応器。

【0014】 このように、一对の単位電極（上側単位電極及び下側単位電極）のそれぞれが、誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成されるため、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極となる。また、一对の単位電極により構成される基

本ユニットの複数が、階層的に積層されて電極ユニットを構成し、それをプラズマ発生電極としたため、熱応力が発生しても基本ユニット間で歪みを緩和することができ、耐熱性に優れたプラズマ発生電極となる。さらに、このようなプラズマ発生電極を有するプラズマ反応器としたため、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能であるとともに、耐熱性に優れたプラズマ反応器となる。

【0015】

【発明の実施の形態】 以下、図面を参照して、本発明のプラズマ発生電極及びプラズマ反応器の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は、これに限定されて解釈されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、種々の変更、修正、改良を加え得るものである。

【0016】 図1(a)、図1(b)は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する基本ユニットを模式的に示すものであり、図1(a)は、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図1(b)は、斜視図である。図2(a)、図2(b)、図2(c)は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する単位電極を模式的に示すものであり、図2(a)は、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図2(b)は、斜視図であり、図2(c)は単位電極を構成する導電膜を示す平面図である。図3は、本発明のプラズマ発生電極を模式的に示す斜視図である。

【0017】 本実施の形態のプラズマ発生電極100は、図3に示すように、一対の単位電極2(図2(a)、図2(b)参照)から構成される基本ユニット1(図1(a)、図1(b)参照)が階層的に3層積層されることにより構成されている。これにより、プラズマ発生電極100は、三対の単位電極2(図2(a)、図2(b)参照)が所定間隔(突条13の厚さに相当する間隔)を隔てて配設されてなり、これらの単位電極2(図2(a)、図2(b)参照)間に電圧を印加することによってプラズマを発生させることが可能となる。

【0018】 図3に示すプラズマ発生電極100を構成する基本ユニット1は、図1(a)、図1(b)に示すように、一対の単位電極2(上側単位電極2a及び下側単位電極2b)が突条13の厚さに相当する間隔を隔てて階層的に積層されて構成されている。一対の単位電極2のそれぞれは、図2(a)、図2(b)

）に示すように、誘電体となる板状のセラミック体19と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜12から形成されるとともに、それぞれの一の表面（単位電極の一の表面）3に、所定形状で（それぞれが略等間隔でかつ略平行になるように）配設された所定厚さ（突条の厚さ）Hの複数の突条13を有する。そして、図1（a）、図1（b）に示すように、一对の単位電極2のうちの一方の単位電極（上側単位電極）2aの、一の表面（単位電極の一の表面）3及びそこに配設された突条13の表面（突条の表面）14と、他方の単位電極（下側単位電極）2bの裏面（単位電極の裏面）4とによって、突条13の配設方向（突条の配設方向）Dの両端が開放された複数の空間Vを形成した状態で、一对の単位電極（上側単位電極2a及び下側単位電極2b）2が、突条の厚さHに相当する間隔を隔てて階層的に積層されて、一つの基本ユニット1を構成している。

【0019】 そして、本実施の形態のプラズマ発生電極100は、図3に示すように基本ユニット1の複数（3つ）が、階層的に積層されて、突条の厚さHに相当する間隔を隔てるとともに、単位電極2及び空間Vが立体的に配列された電極ユニット5からなり、電極ユニット5を構成する単位電極2間に電圧を印加することによって、立体的に配列された空間V内にプラズマを発生させることができる。

【0020】 このように、一对の単位電極（上側単位電極及び下側単位電極）のそれぞれが誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成されるため、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極となる。また、一对の単位電極により構成される基本ユニットの複数、階層的に積層されて電極ユニットを構成し、それをプラズマ発生電極としたため、熱応力が発生しても基本ユニット間で歪みを緩和することができ、耐熱性に優れたプラズマ発生電極となる。

【0021】 図1に示す、単位電極2を構成する導電膜12の厚さとしては、プラズマ発生電極の小型化及び、排ガス等処理する場合に一对の単位電極2間を通過させる被処理流体の抵抗を低減させる等の理由から、0.01～0.1mmであることが好ましく、さらに、0.01～0.015mmであることが好ましい。

【0022】 また、本実施の形態に用いられる導電膜12は、導電性に優れた金属を主成分とすることが好ましく、例えば、導電膜12の主成分としては、タングステン、モリブデン、マンガン、クロム、ニッケル、鉄、銀、銅、白金、及びパラジウムからなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を好適例として挙げることができる。なお、本実施の形態において、主成分とは、成分の60質量%以上を占めるものをいう。

【0023】 単位電極2において、導電膜12は、図2に示すように、テープ状のセラミック成形体11に塗工されて配設されたものであることが好ましく、具体的な塗工の方法としては、例えば、スクリーン印刷、カレンダーロール、スプレー、静電塗装、ディップ、ナイフコート、化学蒸着、又は物理蒸着等を好適例としてあげることができる。このような方法によれば、塗工後の表面の平滑性に優れ、且つ厚さの薄い導電膜12を容易に形成することができる。

【0024】 導電膜12をテープ状のセラミック成形体11に塗工する際には、導電膜12の主成分として挙げた金属の粉末と、有機バインダーと、テルピネオール等の溶剤とを混合して導体ペーストを形成し、上述した方法でテープ状のセラミック成形体11に塗工することで形成することができる。また、テープ状のセラミック成形体11との密着性及び焼結性を向上させるべく、必要に応じて上述した導体ペーストに添加剤を加えてもよい。

【0025】 また、単位電極2を構成する板状のセラミック体19（テープ状のセラミック成形体11）は、上述したように誘電体としての機能を有するものであり、導電膜12が板状のセラミック体19の内部に配設された状態で用いられることにより、導電膜12単独で放電を行う場合と比較して、スパーク等の片寄った放電を減少させ、小さな放電を複数の箇所で見ることが可能となる。このような複数の小さな放電は、スパーク等の放電に比して流れる電流が少ないために、消費電力を削減することができ、さらに、誘電体が存在することにより、単位電極2間に流れる電流が制限されて、温度上昇を伴わない消費エネルギーの少ないノンサーマルプラズマを発生させることができる。

【0026】 基本ユニット1を構成する単位電極2のうちの少なくとも一方が、誘電体となる板状のセラミック体19と、板状のセラミック体19の内部に配

設された、図2(c)に示すその膜厚方向に貫通した膜厚方向に垂直な方向の平面で切断した断面の形状が一部に円弧を含む形状の貫通孔12aが複数形成された導電膜12とを有してなることが好ましい。貫通孔12aの断面形状は、円弧を含まなくてもよい。

【0027】 このように、導電膜12に貫通孔12aを形成すると、さらに均一な放電を、低電圧で得ることができるため、好ましい。

【0028】 上述した貫通孔12aの大きさについては、特に限定されることはないが、例えば、それぞれの貫通孔12aの直径が1～10mmであることが好ましい。このように構成することによって、貫通孔12aの外周上での電界集中が、放電に適した条件となり、一对の単位電極2間に印加する電圧がさほど高くなくとも放電を良好に開始させることができる。貫通孔12aの直径が1mm未満であると、貫通孔12aの大きさが小さくなり過ぎて、貫通孔12aの外周上に生ずる放電が、上述した点を起点とした局所的な放電と似た状態となり、不均一なプラズマが発生する恐れがある。また、貫通孔12aの直径が10mmを超えると、貫通孔12aの内部には放電が生じにくいため、一对の単位電極2間に生じるプラズマの密度が低下する恐れがある。

【0029】 また、本実施の形態においては、貫通孔12aが規則的に配列されることが好ましく、隣接するそれぞれの中心間の距離は、貫通孔12aの直径に応じて、均一かつ高密度なプラズマを発生させることができるような長さとなるように適宜決定されていることが好ましく、例えば、特に限定されることはないが、隣接するそれぞれの中心間の距離が、1.5～20mmであることが好ましい。

【0030】 また、この貫通孔12aは、単位面積当りの貫通孔12aの外周の長さが長くなるように形成されていることが好ましい。このように構成することによって、単位面積当たりに電界不均一な領域の長さ、即ち、プラズマの発生起点となる外周の長さを長くすることができ、単位面積当たりに多くの放電を起こさせて高密度のプラズマを発生させることができる。具体的な単位面積当りの貫通孔12aの外周の長さ(mm/(mm)²)としては、発生させるプラズマの強度等によって適宜設定することができるが、例えば、自動車の排気ガスを処

理する場合には、 $0.05 \sim 1.7 \text{ mm} / (\text{mm})^2$ であることが好ましい。単位面積当りの貫通孔 12a の外周の長さが 0.05 より小さいと局所的な放電が起り、安定な放電空間が得にくくなることもある。 1.7 より大きいと、導電膜の抵抗値が高くなり放電効率が低下することがある。

【0031】 また、本実施の形態においては、単位面積当たりの貫通孔 12a の面積は $0.1 \sim 0.98 (\text{mm})^2 / (\text{mm})^2$ であることが、好ましい。 0.1 より小さいと誘電体電極の静電容量が小さすぎて、排ガス浄化に必要な放電を得ることが難しくなることがある。 0.98 より大きいと、貫通孔による均一な放電効果が得にくくなり、局所的な放電が起りやすくなることがある。

【0032】 図 2 (c) に示す導電膜 12 に形成される貫通孔 12a は、図 1 (a) に示す基本ユニット 1 に形成したときに、突条 13 に重ならないようにすることが好ましい。突条 13 に重ならないようにすることで異常放電することを抑制することができる。

【0033】 板状のセラミック体 19 (テープ状のセラミック成形体 11) は、誘電率の高い材料を主成分とすることが好ましく、例えば、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化珪素、コージェライト、ムライト、チタン-バリウム系酸化物、マグネシウム-カルシウム-チタン系酸化物、バリウム-チタン-亜鉛系酸化物、窒化珪素、窒化アルミニウム等を好適に用いることができる。耐熱衝撃性に優れた材料を主成分とすることによって、プラズマ発生電極を高温条件下においても運用することが可能となる。

【0034】 例えば、酸化アルミニウム (Al_2O_3) にガラス成分を添加した低温焼成基板材料 (LTCC) に導体として銅メタライズを用いることができる。銅メタライズを用いるため、抵抗が低く、放電効率の高い電極が造られるため、電極の大きさが小さくできる。そして、熱応力を回避した設計が可能となり、強度が低い問題が解消される。また、チタン酸バリウム、マグネシウム-カルシウム-チタン系酸化物、バリウム-チタン-亜鉛系酸化物等の誘電率の高い材料で電極を造る場合、放電効率が高いため、電極の大きさを小さくできるため、熱膨張が高いことによる熱応力の発生を、小さくできる構造体設計が可能である。

【0035】 また、板状のセラミック体 19 をテープ状のセラミック成形体 1

1で形成するときのテープ状のセラミック成形体11の厚さについては、特に限定されることはないが、0.1～3mmであることが好ましい。テープ状のセラミック成形体11の厚さが、0.1mm未満であると、隣接する一对の単位電極2間の電気絶縁性を確保することができないことがある。また、テープ状のセラミック成形体11の厚さが3mmを超えると、誘電体として必要とされる厚さを超えて省スペース化の妨げになることがある。

【0036】 テープ状のセラミック成形体11は、セラミック基板用のセラミックグリーンシートを好適に用いることができる。このセラミックグリーンシートは、グリーンシート製作用のスラリー又はペーストを、ドクターブレード法、カレンダー法、印刷法、リバースロールコート法等の従来公知の手法に従って、所定の厚さとなるように成形して形成することができる。このようにして形成されたセラミックグリーンシートは、切断、切削、打ち抜き、連通孔の形成等の加工を施したり、複数枚のグリーンシートを積層した状態で熱圧着等によって一体的な積層物として用いてもよい。

【0037】 上述したグリーンシート製作用のスラリー又はペーストは、所定のセラミック粉末に適当なバインダ、焼結助剤、可塑剤、分散剤、有機溶媒等を配合して調製したものを好適に用いることができ、例えば、このセラミック粉末としては、アルミナ、ムライト、コージェライト、窒化珪素、窒化アルミニウム、セラミックガラス、ガラス等の粉末を好適例として挙げることができる。また、焼結助剤としては、アルミナの場合は、酸化ケイ素、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム等を好適例として挙げることができる。なお、焼結助剤は、セラミック粉末100質量部に対して、3～10質量部加えることが好ましい。可塑剤、分散剤及び有機溶媒については、従来公知の方法に用いられている可塑剤、分散剤及び有機溶媒を好適に用いることができる。

【0038】 また、板状のセラミック体19（テープ状のセラミック成形体11）の気孔率が、0.1～35%であることが好ましく、さらに0.1～10%であることが好ましい。このように構成することによって、板状のセラミック体19（テープ状のセラミック成形体11）を備えた上側単位電極2aと下側単位電極2bとの間に効率よくプラズマを発生させることが可能となり、省エネルギー

一化を実現することができる。

【0039】 単位電極 2 は、上述のようにテープ状のセラミック成形体 11 の表面に導電膜 12 が配設され、さらにその上から、二枚のテープ状のセラミック成形体 11 で導電膜 12 を挟持するようにテープ状のセラミック成形体 11 を配設して形成されたものであることが好ましい。

【0040】 図 1 (a)、図 1 (b) において、単位電極 2 の一の表面に配設される突条 13 は、上記板状のセラミック体 19 と同様の材質であることが好ましい。そして突条の厚さ H は 0.1 ~ 3 mm であることが好ましく、隣り合う突条 13 間の距離 L は 5 ~ 50 mm が好ましい。また、突条 13 の幅 W は 0.5 ~ 5 mm が好ましい。これにより、空間 V 内で効率的にプラズマを発生させることができるとともに、空間 V 内を排ガス等を流入させたときに低抵抗で流動させることができる。

【0041】 図 1 (a)、図 1 (b) に示すように、基本ユニット 1 に電気を導通させるため、基本ユニット 1 が、その上面（基本ユニットの上面）6 の突条の配設領域 A 以外の領域（突条の配設領域以外の領域）B から上側単位電極 2 a 及び下側単位電極 2 b に配設された導電膜 12 を貫通し、導電膜 12 に接触した状態で上下方向に貫通する第一の導通用貫通孔 15 及び第二の導通用貫通孔 16 を有している。第一の導通用貫通孔 15 及び第二の導通用貫通孔 16 は、導電膜 12 に接触していればよく、導電膜 12 を貫通している必要はない。そして、基本ユニット 1 は、第一の導通用貫通孔 15 及び第二の導通用貫通孔 16 のそれぞれの内壁に配設された導電膜（第一の貫通孔導電膜 17 及び第二の貫通孔導電膜 18）を有し、第一の貫通孔導電膜 17 及び第二の貫通孔導電膜 18 と、上側単位電極 2 a 及び下側単位電極 2 b に配設された導電膜 12 とがそれぞれ接触することによって、基本ユニットの上面 6 から基本ユニットの下面 7 までの電氣的な導通を可能とすることが好ましい。第一の貫通孔導電膜 17 及び第二の貫通孔導電膜 18 の材質、厚さ等は、上述の導電膜 12 と同様であることが好ましい。

【0042】 また、図 4 に示すように、基本ユニット 1 を構成する上側単位電極 2 a 及び下側単位電極 2 b のそれぞれに配設された導電膜 12 が、基本ユニット 1 の、突条 13 の配設方向と垂直な方向（単位電極 2 上において突条に対して

垂直な方向) Pの両端部までそれぞれ延設されるとともに、基本ユニット1が、両端部のそれぞれの側の端面に配設された導電膜(第一の端面導電膜21及び第二の端面導電膜22)を有し、第一の端面導電膜21及び第二の端面導電膜22と、上側単位電極2a及び下側単位電極2bに配設された導電膜12とがそれぞれ接触することによって、基本ユニットの上面6から基本ユニットの下面7までの電氣的な導通を可能とするようにしてもよい。ここで、図4は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する基本ユニットを模式的に示すものであり、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図である。第一の端面導電膜21及び第二の端面導電膜22の材質、厚さ等は、上述の導電膜12と同様であることが好ましい。

【0043】 以下、本実施の形態のプラズマ発生電極の製造方法について具体的に説明する。

【0044】 まず、上述したセラミック成形体となるセラミックグリーンシートを成形する。例えば、アルミナ、ムライト、ジルコニア、コージェライト、窒化珪素、窒化アルミニウム、セラミックガラス、及びガラスよりなる群から選ばれる少なくとも一種の材料に、上述した焼結助剤や、ブチラール系樹脂やセルロース系樹脂等のバインダ、DOPやDBP等の可塑剤、トルエンやブタジエン等の有機溶媒等を加え、アルミナ製ポット及びアルミナ玉石を用いて十分に混合してグリーンシート製作用のスラリーを作製する。また、これらの材料を、モノボールによりボールミル混合して作製してもよい。

【0045】 次に、得られたグリーンシート製作用のスラリーを、減圧下で攪拌して脱泡し、さらに所定の粘度となるように調整する。このように調整したグリーンシート製作用のスラリーをドクターブレード法等のテープ成形法によってテープ状に成形して未焼成セラミック成形体を形成する。

【0046】 一方、得られた未焼成セラミック成形体の一方の表面に配設する導電膜を形成するための導体ペーストを形成する。この導体ペーストは、例えば、銀粉末にバインダ及びテルピネオール等の溶剤を加え、トリロールミルを用いて十分に混練して形成することができる。

【0047】 このようにして形成した導体ペーストを、未焼成セラミック成形

体の表面にスクリーン印刷等を用いて印刷して、所定の形状の導電膜を形成し、図5に示す、導電膜配設未焼成セラミック成形体31を作製する。導電膜配設未焼成セラミック成形体31の一の方向の両端部には、後に切断除去される切断代Cを有している。また、導電膜は、未焼成セラミック成形体の表面の中央部を中心にほぼ全体を覆い、切断代Cを有さない側の両端部付近は、その幅方向の中央部に四角形状に配設されている。そして、上記四角形状の導電膜の一方が、中央部を中心に全体を覆っている導電膜と連続して形成されている。ここで、図5は、本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を製造する過程を模式的に示した斜視図である。

【0048】 そして、図5に示すように、導電膜配設未焼成セラミック成形体31の、導電膜が配設されている側の表面に上述の方法で作成し、上記両端部の四角形状の導電膜だけを有する未焼成セラミック成形体32を配設して、2つの未焼成セラミック成形体で導電膜を挟持した原単位電極33を形成する。未焼成セラミック成形体32を配設する際には、温度：100℃、圧力：10MPaで押圧しながら配設することが好ましい。未焼成セラミック成形体32の外形は、導電膜配設未焼成セラミック成形体31の外形とほぼ同一である。得られた原単位電極33は、後に切断除去される切断代Cを有している。

【0049】 次に、図5に示すように、得られた原単位電極33の一の表面側に、その外形が原単位電極33とほぼ同一であるとともに厚さが、単位ユニット1（図1（a）、図1（b）参照）に形成されたときの突条13（図1（a）、図1（b）参照）の厚さと同一で、かつ、その長辺が突条13（図1（a）、図1（b）参照）の長さより若干長く、その短辺が突条13（図1（a）、図1（b）参照）の配設間隔と同一の形状の複数の貫通孔34が、形成された板状の突条形成用枠体35を配設する。突条形成用枠体35は、所定の形状にナイフカットで切断する。突条形成用枠体35の原単位電極33の上記四角形状の導電膜と重なる位置に、同様に四角形状の導電膜を配設している。これら、両端部に形成される四角形状の導電膜は四角形である必要はなく、円形、楕円形、多角形、その他不定形状であってもよい。貫通孔34の長辺は、突条13（図1（a）、図1（b）参照）の長さと同じであってもよい。突条形成用枠体35は、貫通孔3

4の長辺の長さ方向両端側に切断代Cを有する。突条形成用枠体35を配設する際には、温度:100℃、圧力:10MPaで押圧しながら配設することが好ましい。

【0050】 原単位電極33及び突条形成用枠体35のそれぞれの切断代Cを有さない側の両端部に、上記四角形状の導電膜と接触するように導通用貫通孔（第一の導通用貫通孔36、第二の導通用貫通孔37）を形成する。

【0051】 次に、上述のようにして得られた、突条形成用枠体35を配設した原単位電極33と同一のものを作製し、図5に示すように、導電膜配設未焼成セラミック成形体31の電極端子38の向きが互いに反対側を向くようにして、2つの突条形成用枠体35を配設した原単位電極33を積層する。これにより、切断代Cを有する焼成前の基本ユニットが形成される。積層する際には、温度:100℃、圧力:10MPaで押圧しながら行うことが好ましい。本実施の形態では、電極端子38の向きが互いに反対側を向くように、導電膜配設未焼成セラミック成形体31を配設しているが、電極端子38が重ならないようにして、同じ側を向くようにして、導電膜配設未焼成セラミック成形体31を配設してもよい。

【0052】 次に、得られた切断代Cを有する焼成前の基本ユニットを、例えば、3段階層的に積層することにより、切断代Cを有する焼成前の電極ユニットを形成する。基本ユニットの積層数は3段に限られず、目的に応じて何段積層してもよい。積層する際には、温度:100℃、圧力:10MPaで押圧しながら行うことが好ましい。このように、切断代Cを有する焼成前の基本ユニットを予め作製しておき、それを必要に応じて積層することにより、焼成によりプラズマ発生電極を作製したときに、基本ユニット間の接続状態が、基本ユニット内のセラミック成形体の接続状態と比較すると、若干の柔軟性を有するようになるため、熱応力による歪みが発生しても、基本ユニット間で緩衝されて破損を防止することができる。

【0053】 積層した後に、原単位電極33及び突条形成用枠体35のそれぞれの切断代Cを、原単位電極33の位置の表面に対してほぼ垂直な平面で切断して除去する。これにより、突条形成用枠体35の貫通孔34の上記長辺の長さ方

向の両端部が開放され、図1(a)、図1(b)に示す基本ユニット1の、突条13及び突条13の配設方向Dの両端が開放された複数の空間Vが形成され、単位電極2及び基本ユニット1の形状となる。原単位電極33及び突条形成用枠体35のそれぞれの切断代Cとなる範囲は、その切断代Cを切断除去したときに、突条形成用枠体35の貫通孔34の長辺の長さ方向の両端部が開放されるような範囲に形成される。

【0054】 次に、得られた焼成前の電極ユニットを焼成して、図3に示す、基本ユニット1の複数が、階層的に積層されて、突条13の厚さに相当する間隔を隔てるとともに、単位電極2及び空間Vが立体的に配列された電極ユニット5を作製し、プラズマ発生電極100を得ることができる。

【0055】 このように、本実施の形態のプラズマ発生電極は、図1(a)、図1(b)に示す、単位電極2、及び突条13の配設方向Dの両端が開放された複数の空間Vが、単位電極2の外形に切断代C(図5参照)を加えた形状の原単位電極33(図5参照)の一の表面側に、その外形が原単位電極33(図5参照)とほぼ同一であるとともに厚さが突条13と同一で、かつその長辺が突条13の長さと同じ又は長く、その短辺が突条13の配設間隔と同一の形状の複数の貫通孔34(図5参照)が形成された板状の突条形成用枠体35(図5参照)を配設した状態で、原単位電極33(図5参照)及び突条形成用枠体35(図5参照)を、空間Vの両端となる位置で、原単位電極33(図5参照)の一の表面に対しほぼ垂直な平面で切断することによって形成されることが好ましい。

【0056】 本実施の形態のプラズマ発生電極は以下に示す他の方法により製造してもよい。まず、図6に示す、板状のセラミック体42に複数本の突条43を略平行に配設した、突条配設セラミック体41を押出成形により形成する。そして、図7に示す、導電膜配設セラミック体46を構成する板状のセラミック体44を押出成形により形成する。突条配設セラミック体41及び板状のセラミック体44の原料等の条件は、上述の本実施の形態のプラズマ発生電極の製造方法の場合と同様にすることが好ましい。

【0057】 次に、図7に示すように、導電膜45を板状のセラミック体44に配設する。導電膜45の材質、導電膜45をセラミック体44に配設する方法

等の条件は、上述の本実施の形態のプラズマ発生電極の製造方法の場合と同様にすることが好ましい。

【0058】 次に、突条配設セラミック体41の突条43が配設されていない側の面に、導電膜配設セラミック体46を、導電膜45が配設されている側の面を当接させるようにして配設させて積層体とする。そして、このようにして得られた積層体を2段重ねることにより図1に示すような基本ユニットとする。さらに基本ユニットを所定の段数重ねて焼成前のプラズマ発生電極とし、これを焼成することにより、本実施の形態のプラズマ発生電極とすることができる。

【0059】 次に、本発明のプラズマ反応器の一の実施の形態について説明する。図8(a)、図8(b)は、本発明のプラズマ反応器の一の実施の形態を模式的に示し、図8(a)は、被処理流体が通過する方向を含み、単位電極に垂直な平面で切断した断面図であり、図8(b)は、図8(a)に示す被処理流体が通過する方向に垂直なA-A'面で切断した断面図である。図8(a)及び図8(b)に示すように、本実施の形態のプラズマ反応器51は、図3に示したような本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態(プラズマ発生電極100)を備えてなることを特徴とする。具体的には、本実施の形態のプラズマ反応器51は、プラズマ発生電極100と、プラズマ発生電極100を、それを構成する複数の単位電極2間に立体的に配列された空間V内に所定の成分を含有するガス(被処理流体)が導入され得る状態で収納したケース体52とを備えている。このケース体52は、被処理流体が流入する流入口53と、流入した被処理流体が単位電極2間を通過して処理された処理流体を流出する流出口54とを有している。このように構成された本実施の形態のプラズマ反応器51は、空間V内に所定の成分を含有するガスが導入されたときに、空間V内に発生させたプラズマによりガス中の所定の成分を反応させることができる。

【0060】 本実施の形態のプラズマ反応器51は、図3に示したプラズマ発生電極100を備えてなることから、均一かつ安定なプラズマを低電力で発生させることができる。

【0061】 本実施の形態のプラズマ反応器51において、プラズマ発生電極100を配設するときには、破損を防止するため、ケース体52とプラズマ発生

電極 100 との間に絶縁性で耐熱性の緩衝材を介在させることが好ましい。なお、図 8 においては、説明上、基本ユニット 1 が 3 段積層された状態を示しているが、基本ユニット 1 を積層する数はこれに限定されることはない。

【0062】 本実施の形態に用いられるケース体 52 の材料としては、特に制限はないが、例えば、優れた導電性を有するとともに、軽量かつ安価であり、熱膨張による変形の少ないフェライト系ステンレス等であることが好ましい。

【0063】 このように構成されたプラズマ反応器 51 は、例えば、自動車の排気系中に設置して用いることができ、排気ガスを単位電極 2 間に形成される空間 V 内に発生させたプラズマの中を通過させて、排気ガスに含まれる上記所定の成分である煤や窒素酸化物等の有害物質を反応させて無害な気体として外部に排出することができる。

【0064】 複数の基本ユニット 1 を積層したときには、積層した基本ユニット 1 の相互間においてもプラズマが発生する。具体的には、例えば、一の基本ユニット 1 を構成する上側単位電極と、対向配置された下側単位電極との間に放電を生ずるだけでなく、この上側単位電極と、隣接する他の基本ユニット 1 を構成する下側単位電極との間にも放電を起こすことが可能な構成とし、積層したプラズマ発生電極 1 の相互間にもプラズマを発生させることができる。

【0065】 また、図示は省略するが、本実施の形態のプラズマ反応器においては、プラズマ発生電極に電圧を印加するための電源をさらに備えてもよい。この電源については、プラズマを有効に発生させることができるような電気を供給することができるものであれば従来公知の電源を用いることができる。

【0066】 また、本実施の形態のプラズマ反応器においては、上述したように電源を備えた構成とせずに、外部の電源から電流を供給するような構成としてもよい。

【0067】 本実施の形態に用いられるプラズマ発生電極に供給する電流については、発生させるプラズマの強度によって適宜選択して決定することができる。例えば、プラズマ反応器を自動車の排気系中に設置する場合には、プラズマ発生電極に供給する電流が、電圧が 1 kV 以上の直流電流、ピーク電圧が 1 kV 以上かつ 1 秒あたりのパルス数が 100 以上 (100 Hz 以上) であるパルス電流

、ピーク電圧が1 k V以上かつ周波数が1 0 0以上（1 0 0 H z以上）である交流電流、又はこれらのいずれか二つを重畳してなる電流であることが好ましい。このように構成することによって、効率よくプラズマを発生させることができる。

【0 0 6 8】

【実施例】 以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0 0 6 9】

（実施例1）

図3に示す単位電極2（アルミナ誘電体電極）を6段積層したユニット（6段電極ユニット）を作製した。一段の電極大きさは5 0×1 0 0×1 mmで、内部の導電膜（電極）はタングステンペーストを4 0×8 0 mmの広さに、厚さ1 0 μmで印刷した。導電膜には、直径3 mmで間隔5 mmの貫通孔を正三角形で規則的に配列した。幅2 mmで高さ1 mmの突条部を1 8 mm間隔で設けた。電極両端には幅8 mmで高さ1 mmの突条部を設け、中央部に直径3 mmの貫通孔を造った。貫通孔内部にはニッケルメッキで導電膜を付けた。

【0 0 7 0】 厚さ1 2 mmの6段電極ユニットを1 0個を積重ね、金属枠で固定した後、断熱マットで外周を保持して、S U S 4 3 0で作製した円筒状の金属容器に装填し、プラズマ反応器を得た。

【0 0 7 1】 バーナースポーリング装置にプラズマ反応器を取り付け、1 0 0℃-6 0 0℃間加熱・冷却試験を行った。1 0 0 0サイクルの試験後に、金属容器内部の6段電極ユニットを観察したが、破損等は観察されなかった。

【0 0 7 2】 実施例1のプラズマ反応器を、3 0 G、2 0 0 H zの振動試験を行った。1 0 0時間の試験後に、内部の6段電極ユニットを観察したが、破損などは認められなかった。

【0 0 7 3】

（比較例1）

一段の単位電極（誘電体電極）の構造は実施例1と同じで、6 0枚を間隔1 mmで積層し、一体型で焼成した電極ユニットを作製し、S U S 4 3 0で作製した

円筒状の金属容器に装填し、プラズマ反応器を得た。実施例 1 と同じバーナースポーリング試験を行った。1 回の 100-600℃間加熱・冷却で、電極ユニットは破損した。

【0074】

(比較例 2)

50×100×1mmの電極 60 枚と電極平板の両端に幅 8mmで厚さ 1mmのアルミナスペーサをはさんで積み重ね、金属枠で固定して、電極ユニットを作製し、SUS430で作製した円筒状の金属容器に装填し、プラズマ反応器を得た。

【0075】 上記、振動試験を行ったが、1時間で電極ユニットの破損が認められた。

【0076】

【発明の効果】 以上説明したように、本発明のプラズマ発生電極によれば、一对の単位電極（上側単位電極及び下側単位電極）のそれぞれが誘電体となる板状のセラミック体と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜から形成されるため、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能となる。また、一对の単位電極により構成される基本ユニットの複数が、階層的に積層されて電極ユニットを構成し、それをプラズマ発生電極としたため、熱応力が発生しても基本ユニット間で歪みを緩和することができ、耐熱性に優れたものとなる。さらに、本発明のプラズマ反応器によれば、このようなプラズマ発生電極を有するプラズマ反応器としたため、均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能であるとともに、耐熱性に優れたものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する基本ユニットを模式的に示すものであり、図 1（a）は、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図 1（b）は、斜視図である。

【図 2】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する単位電極を模式的に示すものであり、図 2（a）は、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図であり、図 2（b）は、斜視図であり、図 2（c）は単位電極を構成する

導電膜を示す平面図である。

【図 3】 本発明のプラズマ発生電極を模式的に示す斜視図である。

【図 4】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する基本ユニットを模式的に示すものであり、突条の配設方向に垂直な平面で切断した断面図である。

【図 5】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を製造する過程を模式的に示した斜視図である。

【図 6】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する突条配設セラミック体を模式的に示した斜視図である。

【図 7】 本発明のプラズマ発生電極の一の実施の形態を構成する導電膜配設セラミック体を模式的に示した斜視図である。

【図 8】 本発明のプラズマ反応器の一の実施の形態を模式的に示し、図 8 (a) は、被処理流体が通過する方向を含み単位電極に垂直な平面で切断した断面図であり、図 8 (b) は、図 8 (a) に示す A-A' 面で切断した断面図である。

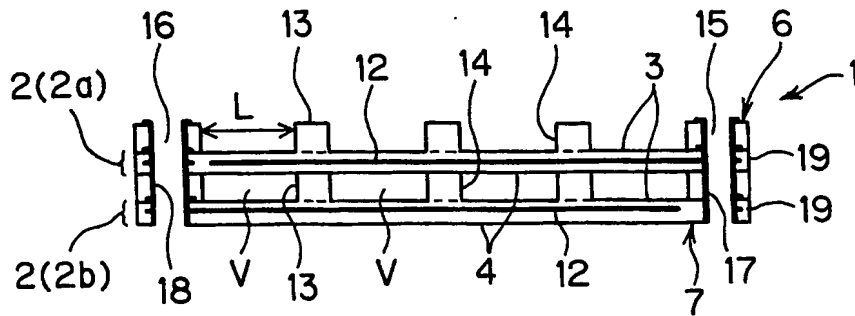
【符号の説明】

1…基本ユニット、2…単位電極、2 a…上側単位電極、2 b…下側単位電極、3…単位電極の一の表面、4…単位電極の裏面、5…電極ユニット、6…基本ユニットの上面、7…基本ユニットの下面、11…テープ状のセラミック成形体、12…導電膜、12 a…貫通孔、13…突条、14…突条の表面、15, 36…第一の導通用貫通孔、16, 37…第二の導通用貫通孔、17…第一の貫通孔導電膜、18…第二の貫通孔導電膜、19…板状のセラミック体、21…第一の端面導電膜、22…第二の端面導電膜、31…導電膜配設未焼成セラミック成形体、32…未焼成セラミック成形体、33…原単位電極、34…貫通孔、35…突条形成用枠体、38…電極端子、41…突条配設セラミック体、42…板状のセラミック体、43…突条、44…セラミック体、45…導電膜、46…導電膜配設セラミック体、51…プラズマ反応器、52…ケース体、53…流入口、54…流出口、100…プラズマ発生電極、A…突条の配設領域、B…突条の配設領域以外の領域、C…切断代、D…突条の配設方向、V…空間、H…突条の厚さ、P…突条に対して垂直な方向、W…突条の幅。

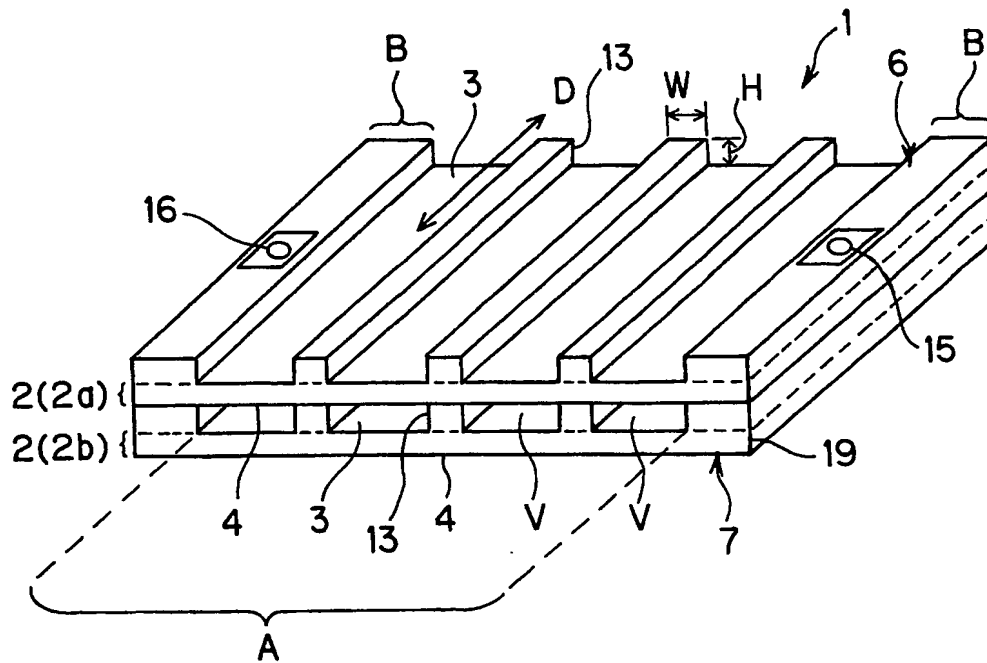
【書類名】 図面

【図 1】

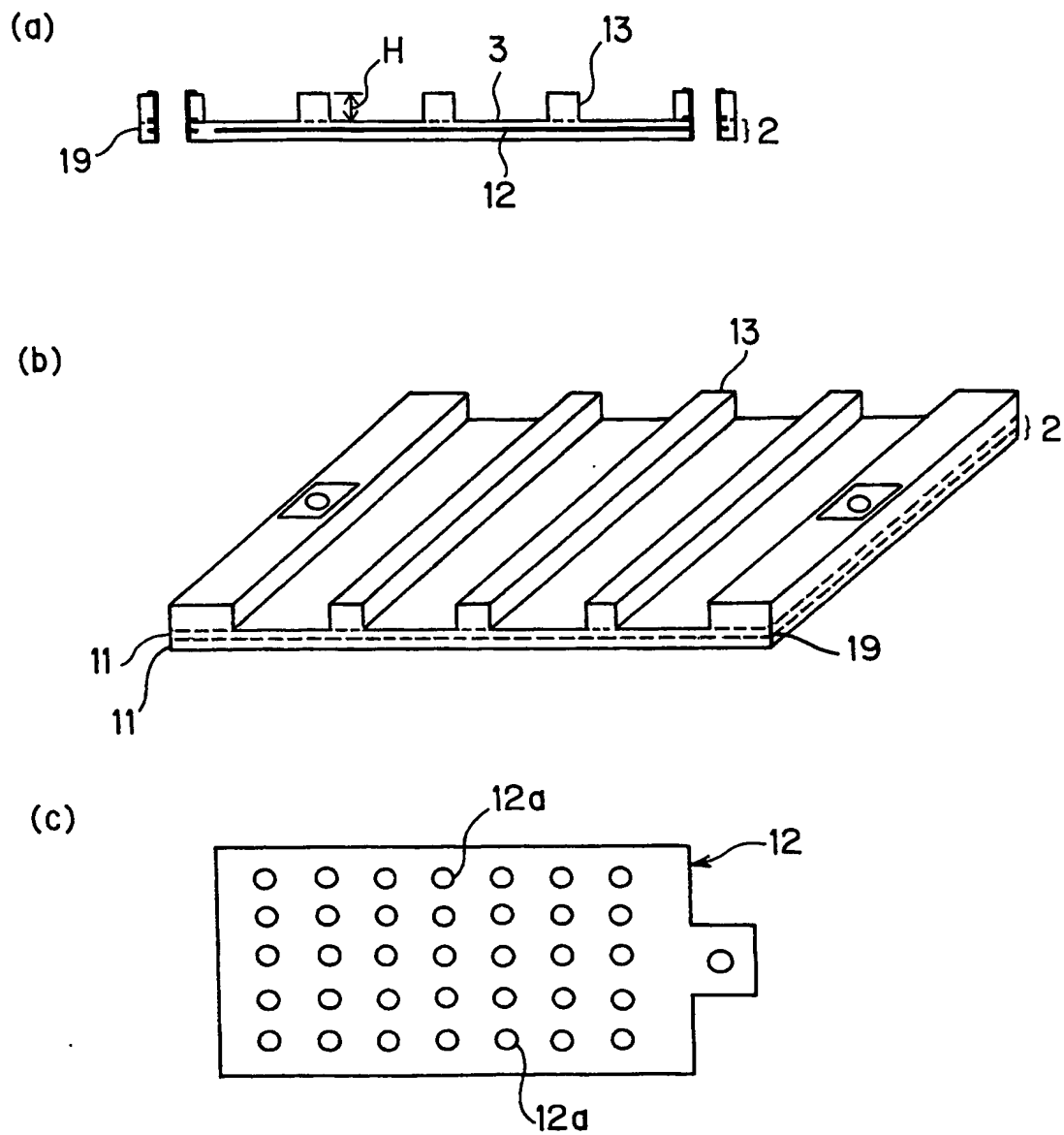
(a)



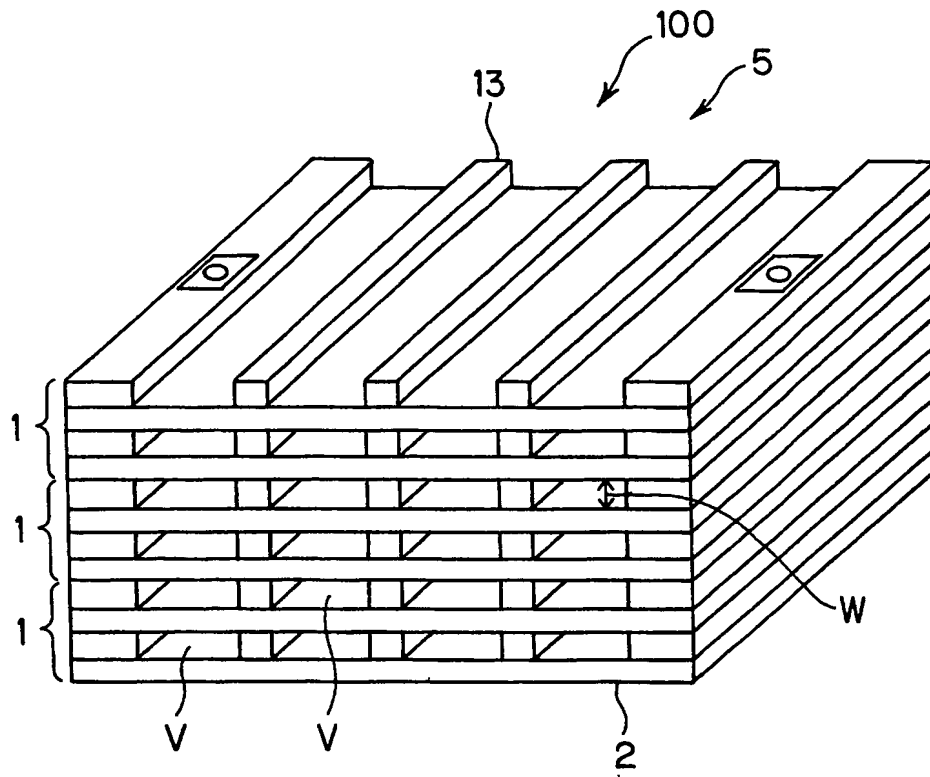
(b)



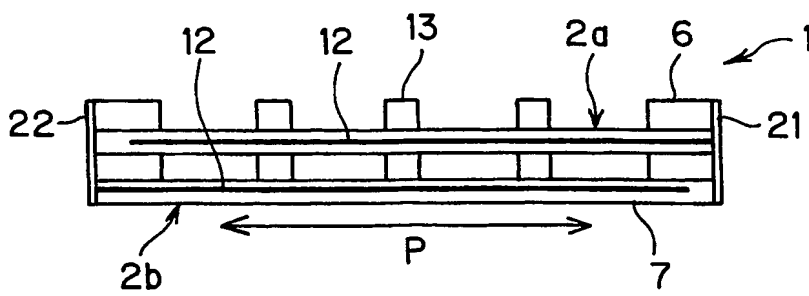
【図 2】



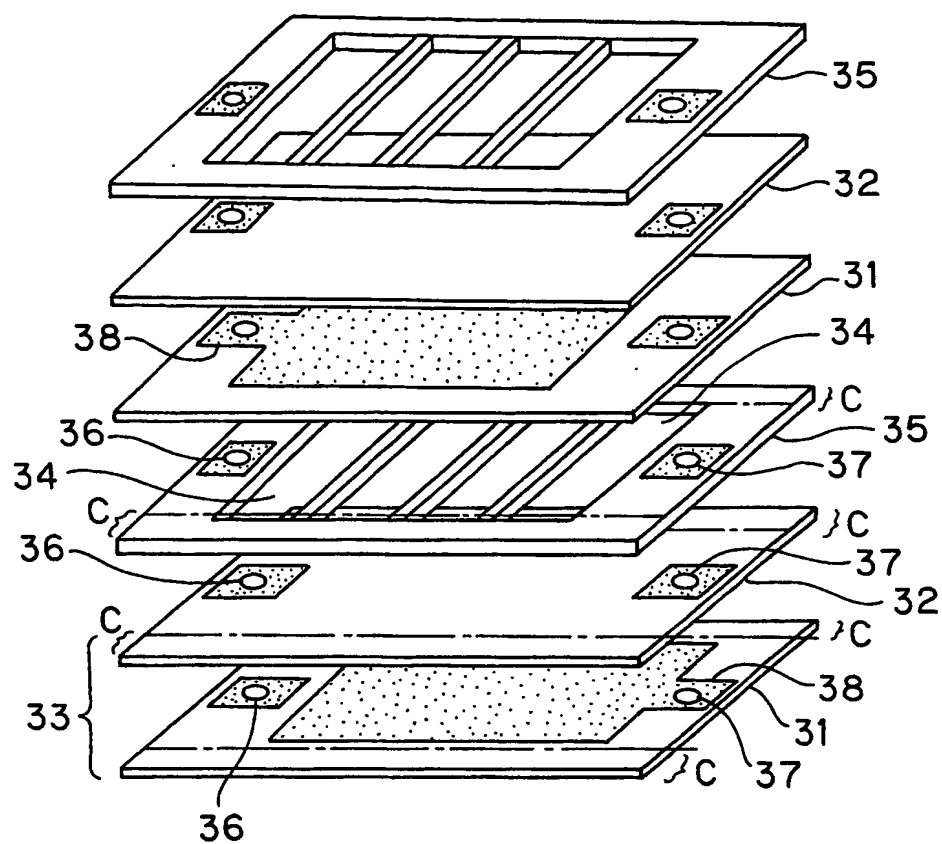
【図 3】



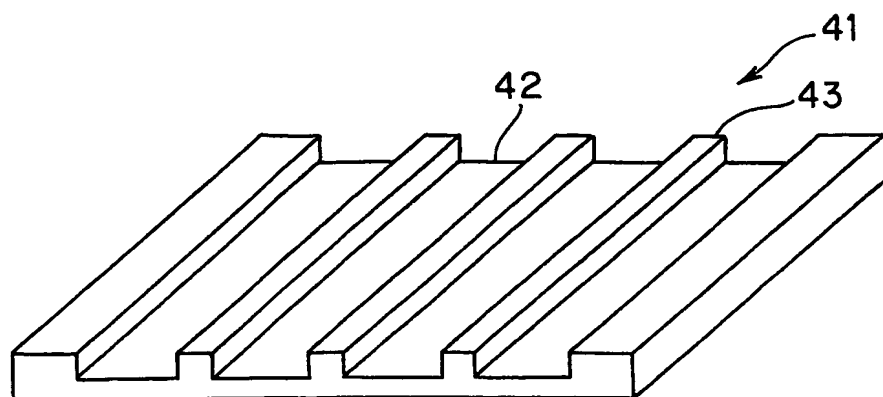
【図 4】



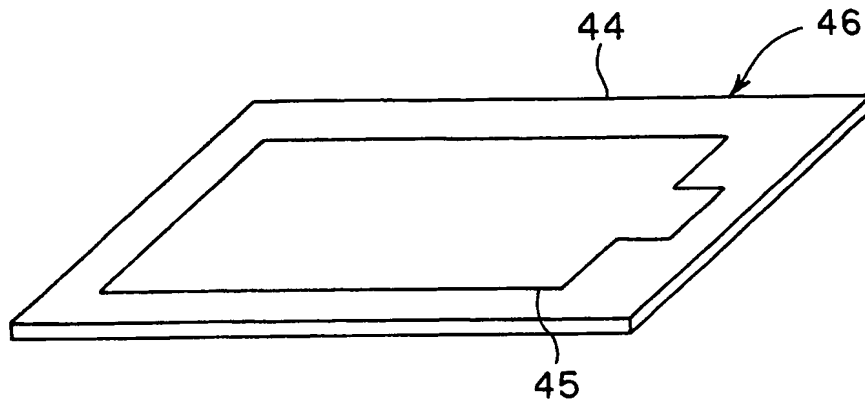
【図 5】



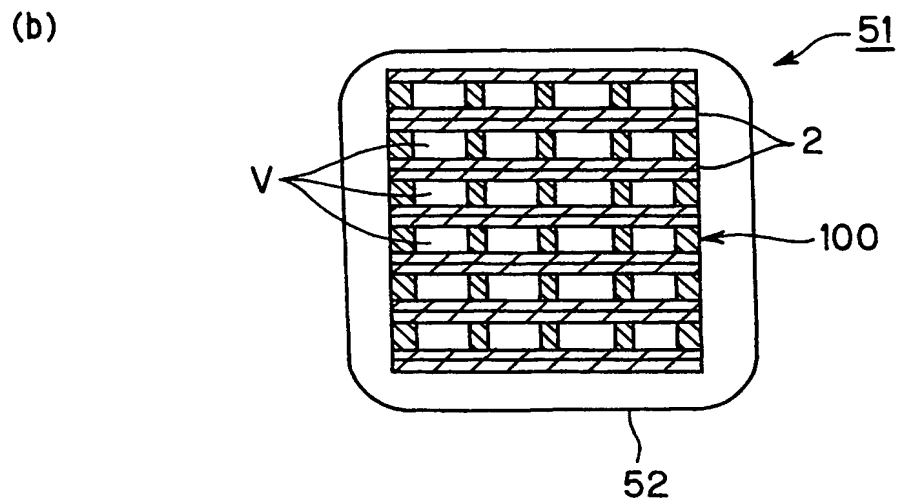
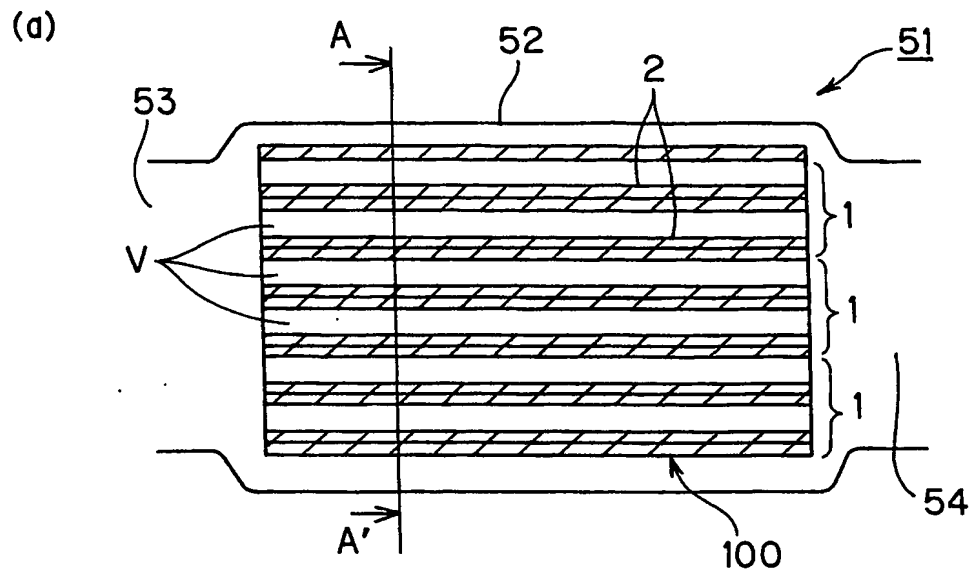
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 均一かつ安定なプラズマを発生させることが可能であるとともに、耐熱性に優れたプラズマ発生電極を提供する。

【解決手段】 一対の単位電極 2 のそれぞれが、板状のセラミック体 19 と、前記セラミック体の内部に配設された導電膜 12 から形成されるとともにそれぞれの一の表面に複数の突条 13 を有し、その一対の単位電極 2 が、突条 13 の配設方向の両端が開放された複数の空間を形成した状態で突条 13 の厚さに相当する間隔を隔てて階層的に積層されて一つの基本ユニット 1 を構成し、さらに基本ユニット 1 の複数の突条 13 の厚さに相当する間隔を隔てて階層的に積層された電極ユニットを構成し、電極ユニットを構成する単位電極 2 間に電圧を印加することによって、立体的に配列された空間 V 内にプラズマを発生させることが可能なプラズマ発生電極。

【選択図】 図 1

【書類名】	出願人名義変更届
【提出日】	平成16年 6月25日
【あて先】	特許庁長官 小川 洋 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願2003-184092
【承継人】	
【識別番号】	000005326
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社
【承継人代理人】	
【識別番号】	100088616
【弁理士】	
【氏名又は名称】	渡邊 一平
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	009689
【納付金額】	4,200円

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-184092
受付番号	50401072542
書類名	出願人名義変更届
担当官	鎌田 柁規 8045
作成日	平成16年 8月20日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】	000005326
【住所又は居所】	東京都港区南青山二丁目1番1号
【氏名又は名称】	本田技研工業株式会社

【承継人代理人】

申請人	
【識別番号】	100088616
【住所又は居所】	東京都台東区浅草橋3丁目20番18号 第8菊 星タワービル3階 渡邊一平国際特許事務所
【氏名又は名称】	渡邊 一平

特願 2003-184092

出願人履歴情報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名

日本碍子株式会社

特願 2 0 0 3 - 1 8 4 0 9 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 9 月 6 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号

氏 名

本田技研工業株式会社